

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】令和 1 年 5 月 16 日 (2019.5.16)

【公開番号】特開 2018-104799 (P2018-104799A)

【公開日】平成 30 年 7 月 5 日 (2018.7.5)

【年通号数】公開・登録公報 2018-025

【出願番号】特願 2016-255283 (P2016-255283)

【国際特許分類】

C 2 5 D 7/12 (2006.01)

C 2 5 D 21/12 (2006.01)

C 2 5 D 17/06 (2006.01)

C 2 5 D 17/08 (2006.01)

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

【 F I 】

C 2 5 D 7/12

C 2 5 D 21/12 C

C 2 5 D 21/12 D

C 2 5 D 17/06 C

C 2 5 D 17/08 G

H 0 1 L 21/68 N

【手続補正書】

【提出日】平成 31 年 4 月 1 日 (2019.4.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0084

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0084】

図 10 は、シール検査、プリウエット処理、および前処理の一実施形態を示すフローチャートである。図 10 に示すステップ 1 からステップ 14 は、図 8 に示すステップ 1 からステップ 14 と同じである。ステップ 15 では、ドレイン弁 162 を閉じた状態で、処理制御部 109 は前処理液供給弁 182 を開き、前処理液供給ライン 181 を通じて前処理液（プリソーク液ともいう）を外部空間 S 内に供給し、基板 W の露出した表面の全体に前処理液を接触させる。前処理液の液面が基板 W よりも高くなった時点で、処理制御部 109 は前処理液供給弁 182 を閉じる。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0108

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0108】

プリウエット液と基板 W との接触は、予め設定された時間の間維持される（ステップ 16）。上記予め設定された時間が経過した後、処理制御部 109 は、大気開放弁 172 a を開き、大気開放ライン 171 a を通じて第 1 外部空間 S1 を大気に連通させる（ステップ 17）。さらに、処理制御部 109 は、ドレイン弁 162 を開き、プリウエット液を第 1 外部空間 S1 からドレインライン 156 を通じて排出する（ステップ 18）。処理制御部 109 は、大気開放弁 172 およびドレイン弁 162 を同時に開いてもよい。なお、ドレインライン 156 に液検出センサが取り付けられてもよい。プリウエット液が第 1 外部

空間 S 1 からドレインライン 1 5 6 を通じて排出された後に、プリウエット液が液検出センサにより検出されなくなった段階で処理完了とし、その後、処理制御部 1 0 9 がドレイン弁 1 6 2 を閉じるようにしてもよい。